### 02;12;06.2

# Детекторы короткопробежных ионов с высоким энергетическим разрешением на основе 4H—SiC пленок

## © А.М. Иванов, Е.В. Калинина, А.О. Константинов, Г.А. Онушкин, Н.Б. Строкан, Г.Ф. Холуянов, А. Hallén

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург Acreo AB, Electrum 236, SE 164 40 Kista, Sweden Royal Institute of Technology Department of Electronic, Electrum 229, Se 164 40 Kista, Sweden

#### Поступило в Редакцию 14 января 2004 г.

Исследована разрешающая способность SiC-детекторов на примере спектрометрии  $\alpha$ -частиц с энергией 5.1–5.5 MeV. Использовалась структура с барьером Шоттки на базе эпитаксиальных пленок *n*-4H–SiC, выращенных методом газотранспортной эпитаксии. Концентрация нескомпенсированных доноров составляла  $(1-2) \cdot 10^{15}$  сm<sup>-3</sup> при толщине пленки 26  $\mu$ m.

Впервые для SiC-детекторов достигнуто разрешение 0.5%, что позволило визуально выявлять пики тонкой структуры *α*-спектра. Для средней энергии образования пары электрон-дырка в 4H–SiC получено значение 7.71 eV.

**Введение.** В последнее время в области регистрации и спектрометрии ядерных излучений полупроводниковыми детекторами значительное внимание уделяется карбиду кремния. Это связано с прогрессом в получении пленок SiC с характеристиками, приемлемыми для конструирования детекторов, как минимум, в их наиболее простом варианте — в виде двухэлектродных "ионизационных камер". По сравнению с широко используемыми в производстве детекторов материалами (германием, кремнием, теллуридом кадмия) SiC выгодно отличается высокой

1



**Рис. 1.** Зависимость нормированной на максимальное значение амплитуды сигнала от напряжения на детекторе. Вставка — структура детектора.

пороговой энергией образования дефектов и бо́льшей шириной запрещенной зоны. Первое обстоятельство является предпосылкой высокой радиационной стойкости детекторов [1,2]. Второе на несколько порядков снижает генерируемый в объеме детектора ток и связанный с ним шум. Поэтому SiC-детекторы способны сохранять работоспособность вплоть до 500°C [3], что в сочетании с химической стойкостью делает их уникальными для специальных применений.

В сообщении приведены результаты по спектрометрии короткопробежных ионов, к классу которых относятся альфа-частицы естественного распада, с помощью детекторов на базе пленок 4H–SiC. Показано, что качество используемых пленок позволяет достичь уровня разрешающей способности по энергии 0.5%.

**Методика эксперимента.** Исследовались характеристики детекторов, сформированных на базе эпитаксиальных слоев 4H–SiC толщиной 26  $\mu$ m, выращенных методом газотранспортной эпитаксии (CVD) с концентрацией нескомпенсированных доноров  $N_d - N_a = (1-2) \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  на коммерческих подложках. Сг барьеры Шоттки площадью  $1 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2$  и толщиной  $0.1 \,\mu$ m, а также Cr/Al базовые контакты формировались методом термовакуумного напыления (рис. 1, вставка).

Для измерения характеристик детекторов использовалась установка, включающая в себя блоки фирмы ORTEC: зарядочувствительный

Источник S1 служил далее для определения предельного разрешения детекторов по энергии. Второй, более интенсивный источник (S2) с энергией 5.39 MeV имел собственную ширину линии FWHM  $\approx 1\%$  (отношение ширины линии на уровне 0.5 от максимума к значению средней энергии). Источник S2 использовался для экспрессного определения эффективности собирания заряда (ССЕ) и оценочных значений разрешения. Кроме значений ССЕ и FWHM детектора в ходе указанных измерений возможно найти величину средней энергии образования пары электрон-дырка в 4H–SiC ( $\varepsilon_{SiC}$ ). Все измерения величин ССЕ, FWHM и  $\varepsilon_{SiC}$  детектора проводились в условиях форвакуума.

**Результаты** эксперимента и их обсуждение. Для режима спектрометрии ядерных частиц оптимальной является ситуация, когда выполняется соотношение  $W \ge R$  (W — протяженность области электрического поля, R — пробег частицы). Для  $\alpha$ -частиц с энергией 5.5 MeV имеем  $R = 18 \,\mu$ m и необходимые значения  $W \approx 20 \,\mu$ m (для нижней границы указанного выше диапазона  $N_d - N_a$ ) достигаются при напряжении U = 365 V. В сформированных барьерах Шоттки, по крайней мере, до U = 500 V величины обратных токов не превышали 1 nA, что обеспечило низкий уровень шумов во всем интервале смещений, используемых при анализе детекторов.

1. Типичный ход нормированного на максимальное значение сигнала детектора в функции U приведен на рис. 1. Величина контактной разности потенциалов принята равной  $U_c = 1.5$  V. Видно, что в диапазоне U = (225-450) V наблюдается насыщение зависимости, что позволяет сделать допущение о полном переносе образованного  $\alpha$ -частицей неравновесного заряда. Смещения  $U \approx 400$  V соответствуют средней напряженности поля  $F \approx 2 \cdot 10^5$  V/cm, что на два порядка выше значений, типичных для Si-детекторов. Это важное обстоятельство, поскольку пропорционально 1/F понижается время диффузионно-дрейфового

растекания трека — стадии, предшествующей непосредственно дрейфу носителей заряда.

Характерно, что при U + 1.5 = 0 V, когда перенос в основном определяется диффузией дырок, уже реализуется величина CCE ~ 0.5. Это указывает на сопоставимую с пробегом  $\alpha$ -частицы длину диффузионного смещения дырок  $L_D$ . Ее значение можно оценить по начальному линейному участку зависимости рис. 1 согласно соотношению:

$$E(0) = (dE_{\alpha}/dx) \cdot L_D$$

Здесь E(0) — энергия, регистрируемая детектором при U + 1.5 = 0,  $(dE_{\alpha}/dx) \approx 200 \text{ keV}/\mu \text{m}$  — удельные потери энергии  $\alpha$ -частицы в начале пробега. Для данных рис. 1 получаем  $L_D = 13.2 \,\mu \text{m}$ , что составляет 75% от пробега *R*. Кроме того, по наклону линейного участка подтверждена величина  $N_d - N_a = 1.1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ , определенная емкостными методами на исходном образце.

2. Наличие на зависимости CCE(U) участка значений  $CCE \approx 1$  служит предпосылкой высокого разрешения по энергии. Разрешение определялось при смещении U = 450 V для двух групп  $\alpha$ -частиц источника S1. Каждая группа содержала линии, отстоящие на 10-14 keV. Указанная сверхтонкая структура разрешалась кремниевым детектором, используемым при калибровке анализатора. Спектры представлены на рис. 2 (вставка) и выполняли роль эталона при сравнении с полученными с помощью SiC-детектора.<sup>1</sup>

Видно из рис. 2, что в случае SiC-детектора детальная структура спектра не разрешается и близко лежащие дублеты сливаются в одну линию. Однако четко проявлются линии, отстоящие на  $\approx 40$  keV, т. е. SiC-детектор позволяет выявить тонкую структуру спектра. Для значений разрешения по энергии получаем FWHM = (0.49-0.52)%. Эта величина может быть незначительно скорректирована к меньшим значениям за счет учета вклада шумов. Ранее полученные наименьшие значения FWHM для SiC-детекторов составляли 8–9% [5,6].

В полупроводниковых детекторах используется "ионизационный" принцип спектрометрии, когда энергия регистрируемого иона преобразуется в заряд неравновесных носителей тока. Преобразованию сопутствуют флуктуации возникающего числа пар электрон-дырка,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Наличие в спектрах пьедестала, спадающего в область больших энергий, связано с высокой скоростью счета импульсов из-за значительной площади ( $\approx 0.5 \, {\rm cm}^2$ ) Si-детектора.



**Рис. 2.** Снятые SiC-детектором спектры  $\alpha$ -распада для смеси изотопов <sup>239</sup> Pu + <sup>240</sup> Pu (левая часть рисунка) и <sup>241</sup> Am + <sup>238</sup> Pu (правая часть). Вставка — вид спектров при использовании кремниевого детектора. Значения энергии, keV: 5105, 5124, 5157, 5168 (для линий 1-4 верхнего рисунка) и 5443, 5456, 5485, 5499 (для линий 1-4 нижнего рисунка).

связанные с ядерным рассеянием ионов на атомах матрицы детектора и с природой ударной ионизации (осуществляемой как дельтаэлектронами, так и самим ионом). В случае кремния фундаментальные ограничения на достижимую величину FWHM составляют  $\approx 0.12\%$ . Поэтому наблюдаемые значения на уровне 0.5% следует отнести за счет флуктуаций возникшего при торможении иона заряда при его дальнейшем переносе в объеме детектора.

3. Очевидно, что значения FWHM должны возрастать в функции потерь заряда  $\lambda = (q_0 - q)q_0$ , где  $q_0$  и q — созданный ионом и зарегистрированный детектором заряды соответственно. Значения  $\lambda$  были получены на основании рис. 1 и соответствовали участку малых смещений, когда в переносе заряда участвует диффузия. Согласно работе [7] при этих условиях зависимость FWHM( $\lambda$ ) оказывается линейной, что и наблюдалось нами (рис. 3). Следует отметить малую величину



**Рис. 3.** Зависимость разрешающей способности детектора от величины потерь заряда. Потери заряда определены согласно данным рис. 1 в области  $U \leq 225$  V.

наклона прямой K = 0.06 сравнительно с рассмотренным в [7] случаем Si-детектора, где оказалось K = 0.36. Коэффициент K характеризует неоднородность потерь заряда по площади детектора, и его малая величина свидетельствует о совершенстве структуры 4H–SiC CVD эпитаксиального слоя.

4. Среднее число пар электрон-дырка определяется величиной энергии, расходуемой на образование пары ( $\varepsilon$ ). В литературе, согласно работе [8], для  $\alpha$ -частиц использовалось значение  $\varepsilon_{SiC} = 8.4 \text{ eV}$ . Однако в недавней работе [9] при регистрации спектров рентгеновского излучения было получено значение  $\varepsilon_{SiC} = 7.4 \text{ eV}$ .

Чтобы вычислить величину  $\varepsilon$ , соответствующую результатам для исследуемых пленок, в спектрах SiC-детектора были определены значения основных пиков, что дало величины  $E_{SiC} = 2579$  и 2421 keV. Поскольку эти пики соответствовали дублетам спектров Si-детектора, были найдены средние энергии этих дублетов, которые составили  $E_{Si} = 5490$  и 5159 keV. Далее из соотношения  $\varepsilon_{SiC} = \varepsilon_{Si} \times (E_{Si}/E_{SiC})$ , используя для  $\varepsilon_{Si}$  величину 3.62 eV, получаем для обеих пар энергий значение 7.71 eV. Заметим, что указанная процедура не учитывает потерь энергии  $\alpha$ -частицы во "входном окне" детектора. В роли последнего выступает образующая барьер Шоттки пленка Cr, и оценка потерь энергии приводит к величине  $\approx 34$  keV или  $\approx 0.6\%$ .

Заключение. В детекторах на базе 4H–SiC CVD пленок с барьером Шоттки реализовано разрешение по энергии  $\approx 0.5\%$ , что позволило визуально выявить тонкую структуру спектров  $\alpha$ -распада.

Прогресс в разрешении обусловлен улучшением условий переноса неравновесного заряда как в отношении увеличения диффузионных длин носителей заряда, так и высокой однородности этого параметра по объему пленки. Степень однородности, как минимум, не уступает уровню кремния.

Достигнуты условия полного переноса заряда, образованного  $\alpha$ -частицей, при его дрейфе в области электрического поля детектора. Перенос происходил при напряженности поля  $\leq 2 \cdot 10^5$  V/cm. При этом не наблюдалось появления избыточных шумов, что свидетельствует о совершенстве как структуры 4H—SiC CVD эпитаксиальной пленки, так и барьера Шоттки.

Для важной в спектрометрии константы — средней энергии образования пары электрон-дырка — получено значение 7.71 eV, что заметным образом меньше приводимого ранее значения 8.4 eV.

Работа была частично поддержана проектом РФФИ № 01–02–17911, а также грантом Президента РФ № НШ–2223.2003.02.

#### Список литературы

- Ivanov A.M., Strokan N.B., Davidov D.V., Savkina N.S., Lebedev A.A., Mironov Yu.T., Ryabov G.A., Ivanov E.M. // Applied Surface Science. 2001. V. 184. P. 431–436.
- [2] Lebedev A.A., Kozlovski V.V., Strokan N.B., Davydov D.V., Ivanov A.M., Strel'chuk A.M., Yakimova R. // Materials Science Forum. 2003. V. 433–436. P. 957–960.
- [3] Калинина Е.В., Холуянов Г.Ф., Давыдов Д.В., Стрельчук А.М., Hallén A., Константинов А.О., Лучинин В.В., Никифоров А.Ю. // ФТП. 2003. В. 37. С. 1260.
- [4] Еремин В.К., Вербицкая Е.М., Строкан Н.Б., Суханов В.Л., Маляренко А.М. // ЖТФ. 1986. Т. 56. В. 10. С. 1987–1989.
- [5] Тихомирова В.А., Федосеева О.П., Холуянов Г.Ф. // Атомная энергия. 1973. В. 34. С. 122.
- [6] Лебедев А.А., Иванов А.М., Строкан Н.Б. // ФТП. 2004. В. 38. С. 129.
- [7] Строкан Н.Б. // Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24. В. 5. С. 44-50.
- [8] Rogalla M., Runge K., Soldner-Rembold A. // Nucl. Phys. B. 1999. V. 78. P. 516– 520.
- [9] Bertuccio G., Casigaghi R. // IEEE Trans. Nucl. Science. 2003. V. 50. P. 175-185.